



Électrostatique

Micro-miroir pour projecteur de cinéma

inspiré de « La physique en applications », Renaud Carpentier

A - Force d'attraction électrostatique entre armatures d'un condensateur plan

1 Cf cours et TD.

2 Le plan (P), situé en $z = d$, est chargé positivement alors que le plan (P'), en $z = 0$, est chargé négativement. Le champ total s'obtient par superposition. On en déduit les résultats suivants :

Valeurs de z	$] -\infty, 0]$	$[0, d]$	$[d, +\infty[$
Champ créé par (P)	$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Champ créé par (P')	$+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Champ total	$\vec{0}$	$-\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_z$	$\vec{0}$

3 À l'intérieur du condensateur,

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dz} \vec{e}_z \quad \text{soit} \quad \frac{dV}{dz} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

En séparant les variables,

$$\int_{V(0)}^{V(d)} dV = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \int_0^d dz$$

ce qui donne

$$V(d) - V(0) = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

où l'on identifie la tension aux bornes du condensateur, d'où

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0 U}{d}.$$

4 L'élément de surface considéré porte une charge σdS , placée dans le champ électrostatique créé par le plan (P'). Il subit donc une force de Lorentz électrique

$$d\vec{F} = \sigma dS \vec{E}_{(P')} = -\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} dS \vec{e}_z.$$

Chaque portion élémentaire du plan (P) subit la même force, si bien que la résultante s'écrit

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = -\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} S \vec{e}_z.$$

En reprenant l'expression de σ établie précédemment,

$$\vec{F} = -\frac{S}{2\varepsilon_0} \frac{\varepsilon_0^2 U^2}{d^2} \vec{e}_z \quad \text{soit} \quad \vec{F} = -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^2} \vec{e}_z.$$

B - Mise en mouvement d'un micro-miroir

5 On a simplement

6 Le micro-miroir subit quatre actions mécaniques : son poids, de moment nul car s'appliquant en O , une action de liaison de moment nul également, et les deux forces \vec{F}_A et \vec{F}_B exercées par les deux électrodes. Ces deux forces ont pour bras de levier $L \cos \alpha$. Étant donné que \vec{F}_A fait tourner en sens direct autour de l'axe (Oz) et \vec{F}_B en sens indirect,

$$\mathcal{M}_z = +F_A L \cos \alpha - F_B L \cos \alpha \quad \text{soit} \quad \boxed{\mathcal{M}_z = \frac{\varepsilon_0 L S_0}{2} \left[\left(\frac{V_M - V_B}{d_B} \right)^2 - \left(\frac{V_M - V_A}{d_A} \right)^2 \right]}.$$

7 On a simplement

$$d_A = d_0 - L \sin \alpha \quad \text{et} \quad d_B = d_0 + L \sin \alpha.$$

8 Imaginons le micro-miroir en position intermédiaire : $d_A = d_B = d_0$. Dans l'état ①, la tension $V_M - V_B > V_M - V_A$, la force exercée par l'électrode B est plus importante, donc le miroir tend à basculer vers la gauche : il est dans la position « 0 ». Réciproquement, l'état d'alimentation ② donne la position « 1 ».

9 Supposons le micro-miroir en position « 0 » pour $t < 0$, avec un basculement de l'état d'alimentation à $t = 0$. Juste après le basculement, $V_M - V_A = 22 \text{ V}$, $V_M - V_B = 17 \text{ V}$ et $\alpha = -10^\circ$ car le micro-miroir n'a pas encore bougé. On a alors

$$\left(\frac{V_M - V_A}{d_0 - L \sin \alpha} \right)^2 - \left(\frac{V_M - V_B}{d_0 + L \sin \alpha} \right)^2 = -1,7 \cdot 10^2 \text{ V} \cdot \mu\text{m}^{-2} < 0.$$

Le miroir reste attiré vers la gauche, et ne peut pas basculer. La phase de lâcher est donc indispensable.

On peut d'ailleurs vérifier que lors de cette phase

$$\left(\frac{V'_M - V_A}{d_0 - L \sin \alpha} \right)^2 - \left(\frac{V'_M - V_B}{d_0 + L \sin \alpha} \right)^2 = 3 \cdot 10^2 \text{ V} \cdot \mu\text{m}^{-2} > 0.$$

Le miroir pivote donc.